

機械器具使用料一覧（現行・改定後）

1精密測定検査用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
投影機	VS-300	神港精機	250	250
画像測定機	Smart ScopeVantage 600	OGP	4,400	4,480
レーザプローブ式非接触三次元測定装置	NH-3SP	三鷹光器	3,700	3,770
精密真円度・円筒形状測定機	タリロンド595	アメテックス(株)テーラーホブソン事業部	5,500	5,610
曲面微細形状測定システム(接触式測定)	フォームタリサーフPGI 1200	アメテックス(株)テーラーホブソン事業部	4,400	4,480
曲面微細形状測定システム(非接触式測定)	VR-3200	キーエンス	1,100	1,120
定盤 (場所:綾部)	グラブレートNo.517-409	ミツヨ	150	150
チェックマスタ (場所:綾部)	HMC-1000H	ミツヨ	150	150
ハイトマスタ (場所:綾部)	HME-600DM	ミツヨ	150	150
ハイトゲージ (場所:綾部)	HDM-100A,HD-30A,HS-30	ミツヨ	100	100
マイクロメータ (場所:綾部)	MDC-25MJ他	ミツヨ	100	100
内測マイクロメータ (場所:綾部)	HT-12ST他	ミツヨ	100	100
セラミックブロックセット (場所:綾部)	BM3-112-K	ミツヨ	350	350
ゲージブロックセット (場所:綾部)	No.613802-013他	ミツヨ	200	200
携帯用表面粗さ計 (場所:綾部)	SJ-301/0.75mN	ミツヨ	450	450
レーザ顕微鏡 (場所:綾部)	LEXT OLS3100	オリンパス	2,100	2,140
CNC三次元測定機 (場所:綾部)	Crysta-ApexC9166	ミツヨ	3,200	3,260
表面粗さ・輪郭形状測定機 (場所:綾部)	SV-C4000CNC	ミツヨ	1,900	1,930
真円度・円筒形状測定機 (場所:綾部)	RA-H5100CNC	ミツヨ	2,300	2,340
リングゲージ (場所:綾部)	No.177-146他	ミツヨ	150	150
三次元光学プロファイラ (場所:綾部)	NewView8300	ザイゴ	3,700	3,770

2材料試験用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
万能材料試験機(1122型・5kN)	1122型	インストロン	1,500	1,530
万能材料試験機(UCT-25T・250kN)	UCT-25T	オリエンテック	1,900	1,930
X線応力解析装置	MSF-2M	理学電機	1,500	1,530
熱膨張記録計	DL-7000H	真空理工	900	910
デジタルロックウェル硬さ試験機	ARD型	アカシ	200	200
エレマ電気炉	KD-10ST	ロベット	350	350
広範囲荷重摩耗試験機	NUS-ISO-3	スガ試験機	100	100
計装化シャルピー 衝撃試験機	CHARPAC	米倉製作所	450	450
マイクロビッカース硬さ試験機	HMV2000AD	島津製作所	250	250
回転摩擦摩耗試験機	TRI-S-500NP	高千穂精機	1,000	1,020
万能材料試験機(UH-1000kNI・1000kN)	UH-1000kNI	島津製作所	3,000	3,060
工業用X線透視装置	SMX-3500M-SP	島津メクテム	3,800	3,870
ナノインデンテーション試験機	ENT-2100	エリオニクス	1,800	1,830
ひずみゲージ式センサ・アンプユニット (場所:綾部)	LU-100KE,LU-1TE,LU-10TE,AS-10HB,AS-100HA,PG-10KU,PG-100KU,DT20D,DPM-712B	共和電業	200	200
ロックウェル硬さ試験機 (場所:綾部)	ARK-600	ミツヨ	400	400
マイクロビッカース硬さ試験機 (場所:綾部)	FM-700	フューチュアテック	450	450
簡易携帯硬さ試験機 (場所:綾部)	エコーチップ硬さ試験機	プロセク	200	200
反発式ポータブル硬さ試験機 (場所:綾部)	HARDMATIC HH-411	ミツヨ	100	100
電気マッフル炉 (場所:綾部)	FUM332PA	アドバンテック東洋	150	150
FFTアナライザー (場所:綾部)	EDX-2000A	共和電業	400	400
振動計 (場所:綾部)	VM-82(ピックアップ:PV-57A)	リオン	100	100
万能材料試験機(250kN) (場所:綾部)	AG-250kNIS MO	島津製作所	3,600	3,670
万能材料試験機(5kN) (場所:綾部)	AG-5kNIS	島津製作所	1,000	1,020
マイクロフォーカスX線透視装置 (場所:綾部)	SMX3000micro	島津製作所	3,800	3,870
機械振動周波数分析システム (場所:綾部)	EDX-200A-1	共和電業	300	300
赤外線サーモグラフィ(R500EX-Pro) (場所:綾部)	R500EX-Pro	日本アビオニクス	550	560
マイクロフォーカスX線CTシステム	TOSCANCSR-32300μFD	東芝ITコントロールシステム	4,000	4,080
万能材料試験機(E10000LT)	E10000LT	インストロン	4,800	4,890
万能材料試験機(E10000LT)(恒温槽仕様)	E10000LT	インストロン	5,800	5,910

3機械加工用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
タッピングボール盤 (場所:綾部)	KRT-340R	キラ・コーポレーション	100	100
手動折り曲げ機 (場所:綾部)	LD-414	盛光	100	100
鏡面ショット研磨機 (場所:綾部)	SMAP II 型	東洋研磨材工業	550	560
電気溶接機 (場所:綾部)	デジタル溶接機	松下溶接システム	1,500	1,530
ベルト研磨機 (場所:綾部)	FS-2N	淀川電機製作所	200	200
両頭グラインダ (場所:綾部)	FG-205T	淀川電機製作所	150	150
高速切断機 (場所:綾部)	SK-1	昭和機械工業	100	100
帯ノコ盤 (場所:綾部)	VZ-300	ワイエス工機	100	100
旋盤 (場所:綾部)	LEO-80A	テクノワシノ	900	910
フライス盤 (場所:綾部)	KGJP-55	牧野フライス製作所	1,500	1,530
小型旋盤 (場所:綾部)	EB-10	エグロ	300	300
3次元切削モデリングシステム (場所:綾部)	MDX-500R	モデリングアール	1,300	1,320

4電気試験用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
赤外線熱画像測定装置	TVS-200Mk II ST	日本アビオニクス	1,800	1,830
真空蒸着装置	EBH-6	日本真空技術	650	660
光デバイス用自動光軸調整装置	U4224	駿河精機	1,000	1,020
超精密研磨機	1 超精密ラッピングポリシング装置 (PM5MA-20K型) 2 ダイヤモンドデ スクソ-(モデル15)	丸本ストルアル	1,200	1,220
高精度マスクアライメント装置	MA-20K型	ミカサ	1,100	1,120
低抵抗率計	Loresta-GP MCP-T610	三菱化学アナリティック	150	150
光コンポーネントアナライザシステム	N4375D	アジレントテクノロジー	5,500	5,610
ベクトルネットワークアナライザ	ME7838A	アンリツ	8,600	8,770
サンプリングオシロスコープ	86100D	アジレントテクノロジー	2,300	2,340
光スペクトラムアナライザ	AQ6370C(Z)	横河メータ&インスツルメン ツ	600	610
電磁波シールド特性測定システム	N9000A	アジレントテクノロジー	500	510
シンクロスコープ (場所:綾部)	DL9040	横河電機	200	200
データレコーダー (場所:綾部)	LX-10	ティアック	200	200
PICマイコンデバッガ (場所:綾部)	MPLABICD2	マイクロチップ	100	100
ファンクションジェネレータ (場所:綾部)	SG-4105	岩通計測	100	100
ユニバーサルカウンタ (場所:綾部)	SC-7206	岩通計測	100	100
直流安定化電源装置 (場所:綾部)	PAN35-5A	菊水電子工業	100	100
EMC測定システム (場所:綾部)	GTEM750	シャフナー	3,500	3,570
ミックスドシグナルオシロスコープ	MS070804	テクトロニス	1,500	1,530
オシロスコープ	MD03054	テクトロニス	200	200
光学特性評価システム(大型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	5,700	5,810
光学特性評価システム(小型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	5,100	5,200
光学特性評価システム(可視光配光ユニット使用)	SR8-LED	システムロード社	5,300	5,400
光学特性評価システム(近赤外光配光ユニット使用)	SR8-LED	システムロード社	5,100	5,200
電磁波妨害評価試験装置(G-TEM)(エミッション測定)	GTEM 750,N9010A-507,A009K251- 5757R,A080M102- 5757R,GA701M282-4850R-LCAなど	TESEQ,Keysight Technologies,アールアンド ケー他	3,100	3,160
電磁波妨害評価試験装置(G-TEM)(イミュニティ試験)	GTEM 750,N9010A-507,A009K251- 5757R,A080M102- 5757R,GA701M282-4850R-LCAなど	TESEQ,Keysight Technologies,アールアンド ケー他	5,600	5,710

5顕微鏡及び試料作製装置

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
モニタリングシステム	KH-2200	ビジネスリンクス	500	510
走査電子顕微鏡(SEM)	JSM-6701F	日本電子	3,300	3,360
倒立型金属顕微鏡	GX51/DP72	オリンパス	850	860
金属顕微鏡 (場所:綾部)	TME200BD	ニコン	250	250
実体顕微鏡 (場所:綾部)	SMZ1000	ニコン	100	100
蛍光顕微鏡 (場所:綾部)	BX51	オリンパス	600	610
金相試料作製装置 (場所:綾部)	ラボプレス1,テグラポール21,テグラ フォース3,テグラドーザ1,ディスコム 6	丸本ストルアス	6,100	6,220

走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (場所:綾部)(観察のみ)	JSM-6390LA	日本電子	3,300	3,360
走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (場所:綾部)(観察+元素分析)	JSM-6390LA	日本電子	4,900	4,990
デジタルマイクロスコープ (場所:綾部)	KH7700	ハイロックス	800	810
走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (場所:綾部)(観察のみ)	JSM-IT300HR 及びJED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	3,400	3,460
走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (場所:綾部)(観察+元素分析)	JSM-IT300HR 及びJED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	5,200	5,300
走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (場所:綾部)(観察+結晶方位分析)	JSM-IT300HR 及びJED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	6,000	6,120
走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (場所:綾部)(観察+元素分析+結晶方位分析)	JSM-IT300HR 及びJED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	7,700	7,850
クロスセクションポリリッシャ (場所:綾部)	IB-19530CP	日本電子	800	810
コンタミネーション解析システム (場所:綾部)	RH-2000-PC	ハイロックス	1,400	1,420
分析型走査電子顕微鏡 (SEM-EDS)(観察のみ)	JSM-7100F	日本電子	4,300	4,380
分析型走査電子顕微鏡 (SEM-EDS)(観察+元素分析)	JSM-7100F	日本電子	5,500	5,610
精密ダイヤモンドバンドソー	BS-300CL	メイワフォーシス	1,000	1,020

6分析用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
X線回折装置	RINT-Ultima III	リガク	3,900	3,970
蛍光X線分析装置	ZSXPrimus II	理学電機工業	5,300	5,400
液体クロマトグラフ	Prominence	島津製作所	900	910
ガスクロマトグラフ	GC-17A	島津製作所	550	560
測色色差計	SQ2000	日本電色工業	300	300
自動ポンペ熱量計	I013-H	吉田製作所	300	300
電子線マイクロアナライザ (EPMA)(WDS又はEDS)	JXA-8200	日本電子	5,100	5,200
電子線マイクロアナライザ (EPMA)(WDS及びEDS)	JXA-8200	日本電子	5,700	5,810
電子線マイクロアナライザ (EPMA)(WDS(カラーマッピングを含む))	JXA-8200	日本電子	6,400	6,520
電子線マイクロアナライザ (EPMA)(全仕様)	JXA-8200	日本電子	7,100	7,240
フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)	IRPrestige-21	島津製作所	2,600	2,650
FEオージェ電子分光分析装置 (全仕様)	PHI-700	アルバック・ファイ	11,000	11,220
FEオージェ電子分光分析装置 (イオン銃不使用)	PHI-700	アルバック・ファイ	8,000	8,160
炭素硫黄分析装置	CS-844	LECO	2,500	2,550
飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC-TOF/MS)	micrOTOF2-kp	ブルカー・ダルトニクス	4,800	4,890
粒子径分布測定装置	SALD-2300	島津製作所	550	560
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	600	610
蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	800	810
レーザーラマン顕微鏡	RAMAN touch	ナノフoton	2,000	2,040
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (場所:綾部)	GCMS-QP2010Plus	島津製作所	3,900	3,970
液体クロマトグラフ (場所:綾部)	Prominence	島津製作所	900	910
紫外・可視分光光度計 (場所:綾部)	V-630	日本分光	150	150
細管式レオメータ (場所:綾部)	CFT-500D	島津製作所	800	810
微量水分計 (場所:綾部)	CA-21	ダイアインスツルメンツ	600	610
有機合成用ドラフトチャンバー (場所:綾部)	RFG-150SZ	ヤマト科学	900	910
示差走査熱量測定装置 (場所:綾部)	DSC-60A	島津製作所	750	760
レーザー回折式粒度分布測定装置 (場所:綾部)	SALD-2200	島津製作所	850	860
分光色差計 (場所:綾部)	NF-333	日本電色工業	100	100
脈波計 (場所:綾部)	APG-1000	ACIMedical	600	610
X線回折装置 II (場所:綾部)	XRD-6100	島津製作所	1,600	1,630
分光蛍光光度計 (場所:綾部)	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	600	610
フーリエ変換赤外分光光度計 (赤外顕微鏡付) (場所:綾部)	IRPrestige-21AIM-8800	島津製作所	2,600	2,650
アミノ酸分析装置 (場所:綾部)	L-8900	日立ハイテクノロジーズ	2,800	2,850
スパーク放電発光分析装置 (場所:綾部)	PDA-7000	島津製作所	2,700	2,750
蛍光X線分析装置 (EDX-7000) (場所:綾部)	EDX-7000	島津製作所	1,700	1,730
顕微紫外可視近赤外分光光度計	MSV-5200 DGK	日本分光	3,500	3,570
イオン分析計	DionexICS-1100	サーモフィッシャーサイエンティフィック	950	960
示差熱・熱量測定装置	DTG-60H	島津製作所	650	660
示差走査熱量計	DSC-60Plus	島津製作所	850	860
熱機械分析装置	TMA-60	島津製作所	1,100	1,120
熱伝導率測定装置	LFA467	ネッチ・ジャパン	2,100	2,140
グロー放電発光分析装置	GD Profiler2	堀場製作所	7,500	7,650

X線光電子分光分析装置(イオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	10,000	10,200
X線光電子分光分析装置(ガスクラスターイオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	13,000	13,260
分光エリブソメータ	UVSEL2	堀場製作所	8,500	8,670
テラヘルツ非破壊検査装置	TAS7500TS	アドバンテスト	10,000	10,200

7表面処理・環境試験用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
冷熱衝撃試験機	ES-106LH	日立アプライアンス	800	810
ポテンシオスタット	HZ-5000	北斗電工	250	250
温湿度サイクル試験装置	PSL-2K	エスベック	700	710
超低温恒温器	MC-811P	エスベック	400	400
蛍光X線膜厚計	EA6000VX	日立ハイテクサイエンス	2,000	2,040
振動試験機(16kN) (場所:綾部)	F-16000BDH/LA16AW	エミック	2,600	2,650
温湿度サイクル試験装置(800L) (場所:綾部)	PL-4K/P計装	エスベック	950	960
小型高温チャンバー (場所:綾部)	ST-120B1	エスベック	100	100
接触角測定装置 (場所:綾部)	FTA-125	FTA	550	560
真空定温乾燥器 (場所:綾部)	DP43	ヤマト科学	350	350
騒音計 (場所:綾部)	NL-22	リオン	100	100
蛍光X線膜厚計 (場所:綾部)	SFT9400	エスアイアイ・ナノテクノロジー	2,100	2,140
電磁・渦電流膜厚計 (場所:綾部)	LZ-200J	ケット科学研究所	200	200
振動レベル計 (場所:綾部)	VM-53A(ピックアップ:PV-83C)	リオン	100	100
耐候性評価システム(キセノン)	XER-W75	岩崎電気	1,600	1,630
耐候性評価システム(メタルハライド)	SUV-W161	岩崎電気	1,500	1,530
表面物性試験装置(CSR-2000)	CSR-2000	レスカ	3,000	3,060

8微生物・食品試験用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
テクスチュロメーター	GTX-2-IN	全研	550	560
レオメータ	NRM-2010J-CW	不動工業	250	250
凍結乾燥機	FDU-1000	東京理化工械	200	200
嫌気性培養装置	EAN-140	タバイエスベック	200	200
リアルタイムPCR装置	Thermal CyclerDice RealTimeSystem 2	タカラバイオ	550	560
噴霧乾燥機	SD-1000	東京理化工械	400	400
超音波ホモジナイザー	Q500	Qsonica	150	150

9映像・工芸技術用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
サンドブラスター	SGK-3型	不二製作所	150	150
アイマークレコーダー	EMR-V	ナック	750	760
ホストCGシステム(基本システム)	ONYX	シリコングラフィックス	4,900	4,990
ホストCGシステム(全仕様システム(画像・映像の入出力機器を含む))	ONYX	シリコングラフィックス	6,900	7,030
ストロボスコープ (場所:綾部)	MS-600	菅原研究所	100	100
デジタルハイスピードカメラ (場所:綾部)	MEMORECAMfxK4	ナック	1,400	1,420
4Kメモリーカムコーダー	PXW-Z100	ソニー	100	100

10造形・試作用

機器名	型式	メーカー	基本額(円) (1機につき1時間)	
			現行	改定後
高速三次元成形機(樹脂粉末積層3Dプリンタ)	RaFaEl 300F	アスペクト	6,900	7,030
3次元CAD/CAM/CAE	ThinkDesign	think3	250	250
非接触3次元デジタイザ (場所:綾部)	VIVID9i	コニカミノルタセンシング	1,600	1,630
3Dプリンター(ラビッドプロトタイプ) (場所:綾部)	dimension Elite	Stratasys	3,000	3,060
高速開発支援センター 高精細3Dプリンタ (場所:綾部)	AGILISTA-3200	キーエンス	2,500	2,550
高速開発支援センター 3次元スキャナ (場所:綾部)	ATOS core45, 200, 500	Gom		
高速開発支援センター VDIシミュレーション (場所:綾部)	Mechanical Enterprise,CFD Enterprise,HFSSMaxwell 3D,ADINA, ソリッドワークス	ANSYS 他		
三次元スキャナ(3D Scanner)(本体)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	1,700	1,730
三次元スキャナ(3D Scanner)(ソフトウェア)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	900	910